

光学式膜厚計



光学式膜厚計
大塚電子（株）
IMUC-7000SP

平成5年度導入

【主な用途・仕様】

シリコン酸化膜等透明薄膜の膜厚測定

- ・測定波長範囲：220～830nm
- ・波長分解能：0.2nm 以下
- ・膜厚測定範囲：0.01～20 μm
- ・最小スポット径：4 μm

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

【設備使用の項目・使用料】 光学式膜厚計

【受託試験の項目・手数料】 マイクロマシニング加工（A）